

G01Q 走査プローブ技術または装置；走査プローブ技術の応用，例．走査プローブ型顕微鏡 [ S P M ] [ 2 0 1 0 . 0 1 ]

注

このサブクラスにおいては，ファーストブレイス優先ルールが適用となる，すなわち各階層レベルにおいて，相反する指示がない限り，最初の適切な箇所に分類する。[ 2 0 1 0 . 0 1 ]

- 10/00 走査または位置決め装置，すなわち，プローブの動きあるいは位置を積極的に制御するための装置 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 10/02 ・粗動走査または粗動位置決め [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 10/04 ・微動走査または微動位置決め [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 10/06 ・それらのための回路またはアルゴリズム [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 20/00 プローブの動きまたは位置の監視 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 20/02 ・光学的手段によるもの [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 20/04 ・自己検知プローブ，すなわち，プローブ自身がその位置を示すような信号を発するもの，例．圧電ゲージ [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 30/00 走査プローブ技術または装置の補助または改良に資する補助的手段，例．表示装置またはデータ処理装置 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 30/02 ・非 S P M 分析装置，例．S E M [ 走査型電子顕微鏡 ]，分光計または光学顕微鏡 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 30/04 ・表示装置またはデータ処理装置 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 30/06 ・エラー補償のためのもの [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 30/08 ・サンプルチェンバー内に所望の環境条件を確立し調節するための手段 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 30/10 ・温度環境 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 30/12 ・流体環境 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 30/14 ・液体環境 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 30/16 ・真空環境 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 30/18 ・外部の環境条件または影響からサンプルチェンバーの内部を保護しあるいは隔離するための手段 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 30/20 ・試料の取扱装置または手段 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 40/00 キャリブレーション，例．プローブのキャリブレーション [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 40/02 ・キャリブレーションの基準またはその製造方法 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/00 特定の型の S P M [ 走査プローブ型顕微鏡 ] またはそのための装置；その基本的な構成

部品 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]

- 60/02 ・マルチタイプ S P M，すなわち 2 つまたはそれ以上の S P M 技術を使用するもの [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/04 ・ S T M [ 走査型トンネル顕微鏡法 ] と A F M [ 原子間力顕微鏡法 ] の組合せ [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/06 ・ S N O M [ 近視野光学顕微鏡法 ] と A F M [ 原子間力顕微鏡法 ] の組合せ [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/08 ・ M F M [ 磁気力顕微鏡法 ] と A F M [ 原子間力顕微鏡法 ] の組合せ [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/10 ・ S T M [ 走査型トンネル顕微鏡法 ] またはそのための装置，例．S T M 用プローブ [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/12 ・ S T S [ 走査型トンネルスペクトロスコピー ] [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/14 ・ S T P [ 走査型トンネルポテンシオメトリー ] [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/16 ・プローブまたはその製造または関連する器具類，例．プローブホルダー [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/18 ・ S N O M [ 近視野光学顕微鏡法 ] またはそのための装置，例．S N O M 用のプローブ [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/20 ・蛍光 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/22 ・プローブまたはその製造または関連する器具類，例．プローブホルダー [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/24 ・ A F M [ 原子間力顕微鏡法 ] またはそのための装置，例．A F M 用のプローブ [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/26 ・摩擦顕微鏡法 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/28 ・凝着力顕微鏡法 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/30 ・走査型ポテンシャル顕微鏡法 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/32 ・ A C モード [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/34 ・タッピングモード [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/36 ・ D C モード [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/38 ・プローブまたはその製造または関連する器具類，例．プローブホルダー [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/40 ・導電性プローブ [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/42 ・機能化 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/44 ・ S I C M [ 走査型イオンコンダクタンス顕微鏡法 ] またはそのための装置，例．S I C M 用のプローブ [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/46 ・ S C M [ 走査型キャパシタンス顕微鏡法 ] またはそのための装置，例．S C M 用のプローブ [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/48 ・プローブまたはその製造または関連する器具類，例．プローブホルダー [ 2 0 1 0 . 0 1 ]

# G 0 1 Q

- 1 0 . 0 1 ]
- 60/50 ・ M F M [ 磁気力顕微鏡法 ] またはそのための装置, 例 . M F M 用のプローブ [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/52 ・ ・ 磁気共鳴 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/54 ・ ・ プローブまたはその製造または関連する器具類, 例 . プローブホルダー [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/56 ・ ・ ・ 磁気コーティングされたプローブ [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/58 ・ S T h M [ 走査型熱顕微鏡法 ] またはそのための装置, 例 . S T h M 用のプローブ [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 60/60 ・ S E C M [ 走査型電気化学顕微鏡法 ] またはそのための装置, 例 . S E C M 用のプローブ [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 70/00 S P M プローブの一般的観点またはその製造または関連する器具類で, グループ G 0 1 Q 6 0 / 0 0 に包含される単一の S P M 技術に特に適合していないもの [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 70/02 ・ プローブホルダー [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 70/04 ・ ・ 温度・震動に誘引されたエラーの補償のあるもの [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 70/06 ・ プローブチップアレイ [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 70/08 ・ プローブの特性 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 70/10 ・ ・ 形状またはテーパ [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 70/12 ・ ・ ・ ナノチューブチップ [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 70/14 ・ ・ 特定の物質 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 70/16 ・ プローブの製造 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 70/18 ・ ・ 機能化 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 80/00 S P M を除く走査プローブ技術の応用 ( マイクロ構造の製造または処理 B 8 1 C ; ナノ構造物の製造または処理 B 8 2 B 3 / 0 0 ; 近接場相互作用を用いる情報の記録と再生 G 1 1 B 9 / 1 2 , G 1 1 B 1 1 / 2 4 , G 1 1 B 1 3 / 0 8 ) [ 2 0 1 0 . 0 1 ]
- 90/00 他に分類されない走査プローブ技術または装置 [ 2 0 1 0 . 0 1 ]